【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年3月12日(2009.3.12)

【公開番号】特開2007-250791(P2007-250791A)
【公開日】平成19年9月27日(2007.9.27)
【年通号数】公開・登録公報2007-037
【出願番号】特願2006-71513(P2006-71513)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/3065　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/302　１０１Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成21年1月21日(2009.1.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
前記処理室で行われる処理の種別は少なくとも，前記処理室内にプロセス処理用基板を搬入して行うプロセス処理と，前記プロセス処理を行う前に前記処理室内に調整用基板を搬入して前記処理室内の状態を調整する処理室内状態調整処理とがあることを特徴とする請求項２に記載の基板処理装置のクリーニング方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
前記各クリーニングレシピはそれぞれ，少なくとも実行時間と処理室内温度を含み，
　前記処理の種別が前記処理室内状態調整処理の場合における前記クリーニングの実行時間と処理室内温度のうちの一方又は両方は，前記プロセス処理で必要となる処理室内の状態に応じて設定されることを特徴とする請求項３に記載の基板処理装置のクリーニング方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項８】
前記処理室で行われる処理の種別は少なくとも，前記処理室内にプロセス処理用基板を搬入して行うプロセス処理と，前記プロセス処理を行う前に前記処理室内に調整用基板を搬入して前記処理室内の状態を調整する処理室内状態調整処理とがあり，
　前記設定情報記憶手段には，少なくとも前記処理の種別ごとにクリーニングタイミングが別々に記憶されることを特徴とする請求項７に記載の基板処理装置のクリーニング方法。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
また，上記処理室で行われる処理の種別としては，例えば処理室内にプロセス処理用基板を搬入して行うプロセス処理と，前記プロセス処理を行う前に前記処理室内に調整用基板を搬入して前記処理室内の状態を調整する処理室内状態調整処理とがある。この場合には，上記設定情報記憶手段には，少なくとも前記処理の種別ごとにクリーニングレシピが別々に記憶される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
このようなクリーニングレシピは例えば実行時間と処理室内温度を含み，前記処理室内状態調整処理後に行う前記クリーニングの実行時間と処理室内温度のうちの一方又は両方は，前記プロセス処理で必要となる処理室内の状態に応じて設定される。これによれば，処理室内の状態に応じた最適なクリーニングを実行することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
また，上記処理室で行われる処理の種別は少なくとも，前記処理室内にプロセス処理用基板を搬入して行うプロセス処理と，前記プロセス処理を行う前に前記処理室内に調整用基板を搬入して処理室内の状態を調整する処理室内状態調整処理とがある。この場合，上記設定情報記憶手段には，少なくとも前記処理の種別ごとにクリーニングタイミングが別々に記憶される。